# アトラス実験のためのシリコン飛跡検出 器のモジュールの性能評価

素粒子物理学 41412018 松尾武

**平成**14年2月12日

# 概要

KEK の 4GeV/c $\pi^-$ ビームラインでアトラス実験のためのシリコン飛跡 検出器(SCT)モジュールのビームテストを行い、その性能を評価した。 シリコンストリップセンサーは実際に実験で使われる最終版、読み出し ASIC は実際に実験で使われる最終版直前の ABCD3T, ハイブリッドも実 際に実験で使われる直前の K4 バージョンである。モジュールはバレルモ ジュールとフォワードモジュールの2種類で、各々放射線照射したもの、 していないものをテストした。放射線照射は $3 \times 10^{14} p/cm^2$ を照射し、こ れは LHC 実験で10年間に受ける照射量である。

読み出し ASIC 内での信号波形分析を行った。パルスシェーピング後の平 均的なピーキングタイム~20ns と設計値が確認された。これは、40MHz(25ns 毎)のビーム・クロシング時間よりも小さい値であり、1.25~10fC の電荷 信号の 1fC 閾値でのタイムウォークを 16ns 以下にし、ビームタギングを 可能にする要請から発している。

位置分解能はストリップのピッチ幅 80 µmから期待される分解能 23µm が確認され、バイアス依存性ならびにスレッシュホルド依存性が少ない ことが分かった。残差分布はクリーンであり、エレクトロニクス、環境 共に低雑音で運転されていることを示している。

収集された電荷量をメディアンチャージで評価した。バイアス依存性の 解析から、放射線損傷を与えていないモジュールは150V付近で3.5fCに 飽和しているが、放射線損傷を与えたモジュールは450V付近で3.5fCに 達するが飽和には達していないように見える。放射線損傷を与えないシ リコン基材の全空乏層化電圧は70V程度であり、ストリップ構造及び表 面電荷の影響が飽和電圧を上げていると解釈される。放射線損傷を受け た基材の全空乏層化電圧は約300Vと確認されている。また、基材はp型 に反転しまたストリップの電気的分離が悪化していることから、飽和状 態に達する電圧は非常に高いことが予想される。にもかかわらず、450V 程度で3.5fC程度に達することからLHCで10年間稼働させたとしても支 障のないことが確認されたといえる。 目 次

# 目 次

1	はじめに			6
	1.1 アトラス検出器とLHCの他の検出器	•••		6
	1.2 内部検出器	••	•	8
<b>2</b>	アトラス実験のための飛跡検出器(SCT)のモジュール			10
_	2.1     シリコン半導体検出器     シリコン・シリーン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ			11
	2.2 放射線損傷			11
	2.3 SCT の特徴			$12^{$
	2.3.1 マイクロストリップ構造			12
	2.3.2 2値読み出し			13
	2.3.3 バレルモジュールとフォワードモジュール	•••	•	13
3	解析结果			13
U				13
	32 $7$ $7$ $7$	• •	•	15
	<ul> <li>3.3 位置分解能の評価</li> </ul>	••	•	20
	3.3.1 ビームの直線の決定	•••	•	$\frac{20}{20}$
	3.3.2 位置分解能			$\frac{-}{20}$
	3.3.3 多重ヒット			$\frac{-\circ}{27}$
	3.4 読み出し ASIC 内の信号波解析			31
	3.4.1 ASIC 内の波高分布の求め方			31
	3.5 読み出し ASIC 内の信号波解析の評価			31
	3.6 モジュールの検出効率の評価			31
	3.6.1 検出効率の決定方法	•••		31
	3.6.2 スレッシュホルド 1fC での検出効率の電圧依存	Ā性		36
	3.6.3 電圧一定での検出効率のスレッシュホルド依存	īΣ		36
	3.6.4 メディアンチャージのバイアス電圧依存性	•••		44
	3.6.5 ノイズオキュパンシーの評価	•••		44
	3.6.6 較正スケールに依存しない信号雑音比の電圧依	存性		
	の評価	•••	•	46
4	結論			49
<b>5</b>	謝辞			50

# 図目次

1	LHC リングと各検出器の位置	9
2	ATLAS 検出器	10
3	内部検出器	11
4	マイクロストリップ構造	12
5	バレルモジュール.......................	14
6	フォワードモジュール	14
7	セットアップ図	17
8	セットアップ図(写真:冷却箱の中に入っている)	18
9	残差分布.............................	22
10	一様分布へのガウスフィット	23
11	標準偏差と RMS	24
12	位置分解能の電圧依存性.....................	25
13	位置分解能のスレッシュホルド依存性	26
14	平均クラスター幅の定義	28
15	平均のクラスター幅の電圧依存性	29
16	平均のクラスター幅のスレッシュホルド依存性.....	30
17	様々なスレッシュホルドにおけるトリガからの時間に対す	
	る検出効率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
18	横軸は時間、縦軸はスレッシュホルド。図 17 の様々なス	
	レッシュホルドに対して2次元プロットを行った。	33
19	40 <i>ns</i> でのスレッシュホルドに対する検出効率	34
20	ASIC 内のパルスハイト	35
21	efficiency の電圧依存性 ......................	37
22	検出効率のスレッシュホルド依存性(モジュール1)	38
23	検出効率のスレッシュホルド依存性 (モジュール2)	39
24	検出効率のスレッシュホルド依存性(モジュール3)	40
25	検出効率のスレッシュホルド依存性(モジュール4)	41
26	検出効率のスレッシュホルド依存性(モジュール5)	42
27	検出効率のスレッシュホルド依存性(モジュール6)	43
28	メディアンチャージのバイアス依存性	45
29	40MHz ランダムサンプリング	47
30	ノイズオキュパンシーのスレッシュホルド依存性	47
31	較正スケールに依存しない信号雑音比の電圧依存性	48

# 表目次

1	パラメタとスキャンした値...................	16
2	SCT モジュール	17
3	モジュールの種類.........................	19
4	ABCD2TとABCD3Tとの違い	19

#### 1. はじめに

# 1 はじめに

現在、素粒子物理学実験の最大のトピックのひとつといえば間違いな く「ヒッグス粒子の探索」が上げられる。このヒッグス粒子というのは 「標準理論」で予言されている粒子である。標準理論は現時点までの実験 データを矛盾無く説明している理論であり、ヒッグス粒子が発見されれば この理論はより確かなものになる。ヒッグス粒子探索や既知の粒子の緒 反応の高い精度の測定及び新粒子の探索を目指した LHC(Large Hadron Collider)実験が2006年からスイスのジュネーブ郊外の CERN(ヨーロッ パ合同原子核研究所)において稼働する予定である。LHC は現在ある電 子・陽電子衝突型加速器 LEP(Large Electron Positron)実験で用いてい た円周 27km のリングを改造して、重心系エネルギー 14TeV, ルミノシ ティー  $10^{34}cm^{-2}s^{-1}$ の陽子・陽子衝突型加速器となる予定である。

LHCの中でも主要な実験装置の1つにATLAS(A Toroidal LHC ApparatuS)検出器がある。日本を含む全35ヶ国・150研究機関が参加している 巨大プロジェクトとして、各国で検出器を製作・開発中である。岡山大学は ATLAS日本グループに属しており、ATLASにおいてビーム衝突点付近 で生成される荷電粒子の飛跡を検出する役割をもつSCT(SemiConductor Tracker)モジュールの研究・開発に参加している。

2000 年 12 月に、茨城県つくば市にある高エネルギー加速器研究機構 (KEK)の東カウンター実験ホールにおいて、ATLAS実験に向けて開発 中のSCTモジュールのテストが行われ、その解析による性能評価がなさ れていた。これまでにも何回かテストは行われ、前回のテストでは実際 に使用する形のモジュールでの性能の評価が行われた。しかし、実際の 実験にはモジュールは多数必要でありモジュールは最終版でてすとする 必要がある。今回のビームテストでは、パーツが量産型、あるいは量産 直前型のものをもちいた最初のテストを行った。

まず最初に、ATLAS検出器の概要を述べ、次にシリコン半導体検出器の動作原理とSCTにおけるその工夫について説明する。そして、ビーム テストによるSCTモジュールの解析及びその結果について報告する。

# 1.1 アトラス検出器とLHCの他の検出器

LHCでは図1に示すように4つの大きな検出器が計画されている。

• LHC-b

- 1. はじめに
  - ALICE(A Large Iion Collider Experiment)
  - CMS(Compact Muon Spectrometer)
  - ATLAS

LHC-b 検出器では、衝突において大量に発生する b クォークを用いて、 CP 非保存の物理などを研究する。ALICE 検出器は鉛イオン同士を衝突 させ、高エネルギー状態での原子核内におけるクォーク・グルーオン・プ ラズマの研究を行う。そして、LHC の主目的であるヒッグス粒子等の新 粒子の探索を主な目的として作られているのが CMS 検出器、アトラス検 出器である。

CMS 検出器は LHC でもっとも高いルミノシティで稼働する検出器で ある。CMS は主に次の部分からなる。

- ミューオンシステム
- 電磁カロリメーター
- 内部検出器
- ハドロンカロリメーター

ミューオンシステムは中央のバレル部分にドリフトチューブ(DT)、 エンドキャップの部分にカソードストリップチェンバー(CSC)、そして バレル部分とエンドキャップ部分両方にレジスティブパラレルチェンバー (RPC)という3つの部分からなる。DTとCSCはミューオンの位置と運 動量を正確に測定するために用いられ、一方 RPCはレベル1トリガーに すばやく情報を伝えるために用いられている。ハドロンカロリメーターは クオーク、グルーオン、ニュートリノの測定、つまりエネルギー、ジェッ トの方向ミッシング・トランスバースエネルギーの測定に用いられる。特 にミッシング・トランスバースエネルギーは新粒子の発見に重要な示唆 をする物理量であり、そのためには  $|\eta| \leq 5$ で良い分解能をもつことが重 要である。電磁カロリメーターは高密度の鉛タングステンを使用し、モ リエール半径を小さくして、高エネルギー分解能を達成する工夫を行っ ている。LHCの初期のロールミノシティーにおいて  $H \rightarrow \gamma\gamma$  というヒッ グス粒子のディスカバリーチャンネルをエンハンスするために、電磁カ ロリメーターが高分解能であることが重要である。 ATLAS 検出器は全長 46m, 高さ 22m, 重量 15,000 トンという巨大な装置である。その外観を図 2 に示す。

図2から分かるように装置は大きく分けて次のパートに分かれており、 各パートはそれぞれ多数のサブディテクターで構成されている。ビーム ラインから近い順に並べて記述すると

- 内部検出器
- カロリメーター
- ミューオン検出器

となる。

内部検出器では生成された粒子の飛跡を精密に測定する。カロリメー ター部分では、粒子のエネルギーを測定する。鉛と液体アルゴン検出器 のサンドイッチカロリメーターである電磁カロリメーターで電子や光子 によるエネルギーを、鉄とプラスティックシンチレーターのサンドイッチ カロリメーターであるハドロンカロリメーターでハドロン(陽子やπ中 間子など)によるエネルギーをそれぞれ測定する。

ミューオン検出器は μ 粒子を検出する。強い相互作用をせず、電子の ようには電磁シャワーを発生させない μ 粒子に対し、この最も外側にあ る検出器を使って同定する。また、μ 粒子の軌道方向をほぼ直行するよ うに Toroidal Magnet によって磁場がかけられており、μ 粒子の軌道を曲 げ、その運動量を精密に測定する。

# 1.2 内部検出器

内部検出器は、もっともビーム衝突点に近い部分に配置される。全体 にビーム方向に平行に 2Teslaの磁場がかかっており、衝突後に生成され る粒子の運動量や崩壊点の高精度測定に耐えうるエレクトロニクスの開 発が進められている。

衝突点から近い順に、

- ピクセル検出器
- シリコン半導体飛跡検出器(SCT)
- Transition Radiation Tracker(TRT)



図 1: LHC リングと各検出器の位置



図 2: ATLAS 検出器

というサブディテクターが配置されている。(図3) ピクセル検出器は内 部検出器のもっとも内側に位置している。ピクセル検出器は衝突点の近 くでクリティカルなトラッキング情報を収集し、セカンダリバーテック スを決定するのが大きな役割である。もっとも放射線があたる場所であ り、放射線に強いことも重要である。TRT は内部検出器のもっとも外側 に位置し、ストローのような構造になっている。主には電子の識別をす る。内部検出器はなるべく物質量が少なくなるように設計されているが、 それでもゼロになることはない。そのため内部検出器内の物質と相互作 用を起こし電子が発生する。このバックグラウンドの電子を識別するこ とが重要でTRT はその役目をになっている。

# 2 アトラス実験のための飛跡検出器(SCT)のモジュール

ATLAS SCT モジュールの構造は、シリコンマイクロストリップ型半 導体検出器である。ここではまず半導体検出器において簡単に触れ、其 のあとで SCT の特徴に触れる。



#### 図 3: 内部検出器

## 2.1 シリコン半導体検出器

シリコン半導体検出器における信号は、荷電粒子が空乏層と呼ばれる 領域を通過する際の電離損失により発生する電子・正孔対である。

半導体検出器の利点としては、電子・正孔対を生成するエネルギーが 小さいことが挙げられる。ガスチェンバーの動作原理は半導体検出器と 良く似ていて、電子・イオン対生成がこれにあたるが、電離するのに必 要なエネルギーが 30eV であるのに対し、シリコン半導体検出器が 1 つの 電子・正孔対を生成するのに必要なエネルギーは常温 300K で 3.6eV と 10 分の1 ほどである。これによってエネルギー分解能がよくなるのである。 また、電子・正孔対を収集するのに必要な時間が厚さ 300 µm 以下の検出 器では 3ns 以下であるから大量のデータを短時間で扱う SCT にとって実 に良い特性である。

# 2.2 放射線損傷

半導体検出器は放射線損傷によって性能が劣化する。 最も良く見られる現象はフレンケル欠陥と呼ばれるものであり、照射 された粒子によって半導体物質の原子が其の正常な格子位置から変位し て作られる。欠陥は生成されたキャリアを捕獲し、収集効率を下げる。ま た、pn 接合にバイアスをかけた場合には、特に電離性放射線が無い場合 でもわずかな電流が観測される。これを漏れ電流と呼ぶが、これは放射 線損傷によって増加する。漏れ電流は信号のノイズの原因になるが、そ の増加によって熱を発生する。熱によって漏れ電流は増加し、また熱を 出すという熱暴走を起こす。

SCT の設置される場所において、最もビーム衝突点に近いところでは、 10 年間の実験期間において  $3 \times 10^{14}$  protons/*cm*<sup>2</sup> の放射線損傷を受ける ことが予想されるので、それに耐えうる検出器の開発が進められている。 また、漏れ電流による熱の発生を抑えるためにも、実験環境は 10 年間を 通してマイナス 7°*C* 以下に保つことが要求されている。

## 2.3 SCTの特徴

## 2.3.1 マイクロストリップ構造

nまたはp型半導体の一方をストリップ構造にすると、個々のストリップから信号を読み出すことによって、より精度の高い位置情報を得ることが可能である。SCTでは、nバルクpストリップ読み出しを採用している。また、pストリップとアルミニウム電極の間に酸化層を形成し、漏れ電流を抑えている。(図4)



図 4: マイクロストリップ構造

#### 2.3.2 2値読み出し

LHC においては陽子-陽子衝突が 25ns に一回の頻度で起こり、数百億 個の粒子が生成される。大量のデータを高速で扱うために、SCT は各チャ ンネルから得られる信号に対してスレッシュホルドをかけ、それを超えた ものを1、超えなかったものを0とする On-Off 読み出しを行っている。 これを2値読み出しと読んでいる。

2.3.3 バレルモジュールとフォワードモジュール

SCT モジュールは2タイプの形状があり、内部検出器に配置される場所の違いからそれぞれバレルモジュール,フォワードモジュールと呼ばれている。

バレルモジュール(図5)はストリップ幅  $14\mu m$ 、ストリップ間隔  $80\mu m$ で全部で 768 ストリップある。 $6.36cm \times 6.40cm \times 300\mu m$ のウェーハを、2 枚つなげて 12 cmストリップ長とする。これを 2 枚用いて互いに 40mradの角度をつけて配置した形となっている。これによって、粒子が通過し た位置の 2 次元の情報を得るようにしている。

読み出しエレクトロニクスは、読み出しチップを載せた回路(Hybrid) である。読み出しチップは1つで128ストリップの信号を担当させる。し たがって、片面に6つの全12チップが1つのモジュールにある。

一方、フォワードモジュール(図6)の方は円盤状に配置されるように シリコンウェーハが台形のものを用いる。配置される位置によって異な る3種類のサイズがある。読み出しストリップ数は768×2=1536スト リップ、チップ数6×2=12チップというのはバレルモジュールと同じ である。

# **3** 解析結果

# 3.1 目的

本ビームテストの目的は以下の通りである。

- 実際に実験で使われる最終版及び最終版直前のパーツを用いたテ スト
- 照射前及び LHC10 年分 (3 × 10<sup>14</sup>) 照射後のモジュールの評価

# 3. 解析結果



図 5: バレルモジュール



図 6: フォワードモジュール

これまでにも何回かビームテストは行われている。前回までの実験ではア トラス検出器に組み込む形、読み出しチップ数12チップ、1536ストリッ プ、12cmストリップ長で行われたがモジュールの形にはなっていない[6]。 今回の実験ではモジュールの形に加え実際に実験で使う最終版、及び最 終版直前のパーツをもちいておこなったというところが新しい点である。 より実際に近い条件で行われたビームテストである。なお、本解析はア トラス日本グループが開発、製造したバレルモジュールについて解析を 行っている。

## 3.2 セットアップ

ビームテストは 2000 年 12 月に、つくば市にある高エネルギー加速器研 究機構の 12 GeV 陽子シンクロトロン  $\pi^2$  ビームラインにおいて、4 GeV/c の  $\pi^-$  ビームを用いて行った。そのセットアップを図7に示す。図7中の TelescopeA,B,C と称しているのは、ビームの通過位置を決定するために 用いた検出器である。Telescope もまたシリコンマイクロストリップ検出 器で、面積 2 cm×2 cm で読み出しストリップ間隔 50 $\mu$ m,厚さ 300 $\mu$ m のウ エハを使用し、これを 2 枚 90° ずらして配置することにより、通過した荷 電粒子の 2 次元情報を得る。アナログ読み出しで、その分解能は 5 $\mu$ m で ある。

図8のように、テスト検出器及び Telescope はともに冷却箱の中にセットされ、実際のアトラス実験とほぼ同様の –10°C の状態に保って実験を行った。冷却箱の上流と下流にセットしたシンチレーションカウンターによってトリガーをかけ、そのときのテスト検出器および Telescope からの信号を読む。

イベント収集において、各バイアス電圧・読み出し信号にかけるスレッ シュホールドの値をかえながらデータ収集を行った。スキャンポイント は表1に示してある。各スキャンポイントにおいてそれぞれ 10000 イベ ント集めた。

放射線損傷を与えた Module3,Module4 については、放射線損傷を与え ていないものよりもバイアス電圧を高めに設定してある。これは、損傷 をあたえることによって全空乏層化電圧が増加するためである。

最もビームの下流に配置されている Anchor と称しているものはバレル モジュールである。このモジュールはほんのわずかにタイミングをミス しているテスト検出器と Telescope のコインシデンスを調整するために用

$150,\!200,\!250,\!300,\!325,$
$350,\!375,\!400,\!450,\!475,\!500$
0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1,
1.2, 1.3, 1.5,
1.7, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8,
$3.0, \! 3.5, \! 3.8, \! 4.0, \! 4.5, \! 5.0, \! 5.5, \! 6.0$
25, 50, 75, 100, 125, 150,
$175,\!200,\!225,\!250,\!275$
0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1,
1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 2.0, 2.3,
2.5, 2.8, 3.0, 3.5, 3.8, 4.0,
4.5, 5.0, 5.5, 6.0

表 1: パラメタとスキャンした値

いられている。実験の間、Anchorにかかるバイアスは150Vに固定した。 今回のビームテストには基本的にチップにABCD3Tをつかっているが、 モジュールに対する工夫(ダブルデッカー、シンメタライズ、後述)が Module number 1, 2 でなされている。また、今回のビームテストの目的 として ABCD3T という新しいバージョンでのテストという項目が掲げら れているが、前バージョンの ABCD2T との違いを表4に示している。モ ジュール番号1にはダブルデッカー,モジュール番号2にはシンメタライ ズのモジュールを使用している。それらの説明は表3にある。なぜシン メタライズを試したのかは次の通りである。

ABCD チップは、最新の半導体技術、SOI ウェーハーを使用している。 SOI では、基材のシリコンが基本的に表面の回路部分から絶縁されてお り、裏面に何もしなければ裏面も酸化シリコンで覆われ、絶縁された導 電体が表面回路の下にあることになる。この導電体を通して入力出力の フィードバックが起こり発振する可能性がある。このフィードバックルー プを消すには、導体をグラウンドに落すことであり、導電接触を取るた め裏面を金属処理しハイブリッドのグラウンドと接続する。薄くする理 由は、シリコン基材は抵抗があり、基材とハイブリッドグウランドとの 接触抵抗を下げるためである。



図 7: セットアップ図

モジュール番号	状態	モジュールの型
1		バレル
2		バレル
3	放射線照射有	バレル
4	放射線照射有	フォワード
5		フォワード
6		フォワード

表 2: SCT モジュール



図 8: セットアップ図(写真:冷却箱の中に入っている)

モジュールの種類	説明
ダブルデッカー	500µmの厚さ。裏側になんの加工もしてい
	ないので石英(酸化シリコン)が剥き出し。
	酸化シリコンによって絶縁されている。チッ
	プの脇にパスコンがついている。早い電力
	供給のため電圧が降下するのを防ぐために
	ついている。
シンメタライズ	抵抗を少なくするため裏面を金属で表面処
	理している(グラウンドに接地)。厚さ
	300~350µmぐらい。

# 表 3: モジュールの種類

チップバージョン	説明
ABCD2T	各チャンネルごとにスレッシュホルドを微妙
	に決めるトリム回路が入っている。トリムす
	るステップ、すなわちデジタル-アナログ変
	換の係数は固定。
ABCD3T	ABCD2T チップのトリム回路のデジタル-
	アナログ変換の係数を4段階に選択できる
	ように追加。これは、放射線損傷を受けた
	後、デジタル-アナログ変換の係数がかわっ
	てしまうので、これを補償するためである。
	ABCD3Tmというのはシンメタライズのモ
	ジュールにつけるチップ(基本バージョンの
	ABCD3Tよりチップを薄くしている)をと
	りあえずこう読んでいる。

表 4: ABCD2T と ABCD3T との違い

#### **3.3** 位置分解能の評価

3.3.1 ビームの直線の決定

ビームの直線の出し方は3台のテレスコープを用いて行う。テレスコー プのヒット情報から、

- まず、テレスコープ 0,2 の 2 台のデータで直線を出す。
- その直線から得られるテレスコープ1における通過位置と、実際に ヒットしたテレスコープ1の通過位置との差を出す。
- 各テレスコープに複数の通過位置の情報があれば、差が最も小さい ものを選ぶ。

その差が、150µm 以内 (テレスコープのストリップの3ピッチ分の長さ) にあり、かつ同時に Anchor Module でも同じことが言えたのなら、良い 直線であるとしてその後の解析に用いる。両面 (xy) ともにその条件を満 たさなかった場合は、そのときのイベントは解析に用いない。

#### 3.3.2 位置分解能

テレスコープから算出したテスト検出器のビームの通過位置と、実際 にヒットのあったテスト検出器のヒット点との残差をとる。これを同じ 条件下で行ったイベント数だけ繰り返し、残差分布を作成する。

次にテレスコープにより算出された通過位置から前後5ストリップの 領域を考え、其の中にヒット点がなかったイベントを除く。

これをガウスフィットさせて得られた標準偏差を位置分解能とする(図 9)。しかし、これは期待される一様分布の位置分解能  $\frac{80}{\sqrt{12}} \sim 23 \mu m$  より 悪い値になる。これについて以下の原因が考えられ、それぞれに対して 補正をおこなった。

まず、図7を見るとモジュール1,6はテレスコープの外にある。よって このテスト検出器のヒット点と比較するテレスコープから算出された点 は二つの点を結ぶ直線を外挿した点である。他のテスト検出器はテレス コープの間にある。ビームはテスト検出器あるいはテレスコープで多重 散乱を起こす可能性があるので直線を外挿した点とヒット点を比較して いるモジュール1,6はほかのテスト検出器よりも位置分解能が悪くなると 考えられる。よってモジュール1,6に対して多重散乱の効果を考慮した。 また、

分布は一様分布(図10の黒線)になるはずである。そして本来欲しい 値は一様分布のRMSである。しかし、解析の段階でその一様分布にガウ スフィット(図10の赤線)をして、その標準偏差を位置分解能としてい る。ガウス分布はRMSと標準偏差は同じ値であるが、一様分布のRMS とそれにフィットした標準偏差の値は当然異なるはずである。であるか ら、標準偏差をRMSに変換した。方法は以下の通りである。まず、様々 なRMSの値に関してガウスフィットを行う。そのときのRMSと標準偏 差をプロットする。そして、それに直線をフィットした。その直線を標準 偏差をRMSに変換する関数とした(図11)。

図12にスレッシュホルド1fC一定での位置分解能の電圧依存性を示した。放射線損傷がないものに関しては、期待される位置分解能23µmの値が得られた。放射線損傷があるものに関しては放射線損傷がないものよりも位置分解能がよくなっている。これはストリップの多重ヒットの影響である。電圧が50V以下に下がると位置分解能が良くなっているがこれはストリップの有感領域がせまくなるからである。位置分解能はよくなるが検出効率は低くなる。

図 13 に電圧一定での位置分解能のスレッシュホルド依存性を示した。 放射線損傷がないものに関しては電圧は 200V、放射線損傷があるものに 関しては電圧は 450V である。スレッシュホルド 1fC 辺りでは期待される 位置分解能 23µm に近い値である。また、スレッシュホルドが高いとこ ろと低いところで位置分解能が良くなっている。これは以下の理由によ ると考えられる。

まず、スレッシュホルドが高いところで位置分解能が良くなっている のはストリップの有感領域が狭くなるからである。これによって位置分 解能は良くなるけれども、検出効率(エフィシェンシー)は下がる。ス レッシュホルドが低いところで位置分解能が良くなるのはストリップの 多重ヒットが増えるためである。



図 9: 残差分布



図 10: 一様分布へのガウスフィット



図 11: 標準偏差とRMS



図 12: 位置分解能の電圧依存性



図 13: 位置分解能のスレッシュホルド依存性

#### 3.3.3 多重ヒット

前にマルチヒットの場合のクラスタ点の決定の仕方について書いたが、 ここではシングルヒットとマルチヒットの数の割合について評価する。こ の評価の指標として平均のクラスター幅を定義する。その定義は以下の 通りである。

● 平均のクラスター幅 (MCW)の定義

図 14 はマルチヒットの数をあらわしたものである。 2 はダブルヒット、 つまりストリップの連続した 2 つにヒットがあったことを示している。図 14 でいうと

 $MCW = \sum_{i} h_i \times n_i$ 

 $h_i: ヒットしたストリップ数$ 

*n*<sub>i</sub>:イベント数

によって与えられる。

平均のクラスター幅の電圧依存性を図15にしめした。電圧に関しては ほとんど依存性は見られないが、放射線損傷がないテスト検出器よりも 放射線損傷があるテスト検出器のほうが多重ヒットの割合が大きいとい える。

平均のクラスター幅のスレッシュホルド依存性を図16に示した。こち らは放射線損傷があるかどうかによって違いはみられないが、どちらも スレッシュホルドが低くなると多重ヒットの割合が増えている。



図 14: 平均クラスター幅の定義



図 15: 平均のクラスター幅の電圧依存性



図 16: 平均のクラスター幅のスレッシュホルド依存性

3. 解析結果

## 3.4 読み出し ASIC 内の信号波解析

3.4.1 ASIC 内の波高分布の求め方

SCT モジュールは高速化のために電子-正孔対からくるアナログ波形信号を、スレッシュホルドを越えたか否かでデジタル読み出しを行っている。よって ASIC 内の波高分布は直接見ることはできない。よってつぎのような方法で波高分布を間接的に求めた。

まず、図17に様々なスレッシュホルドに対してトリガからの時間に対 する検出効率を示した。それらを2次元プロットにまとめたものが図18 である。それを各時間に対して、スレッシュホルドに対する検出効率を 図19に示す。そして、検出効率50%のスレッシュホルドを波高とした。 時間に対する波高を求めると図20のようになる。

# 3.5 読み出し ASIC 内の信号波解析の評価

図 20 に ASIC 内の波高分布を示した。アトラス検出器は 25ns 毎にビー ムが衝突する。したがって、ピーキングタイムが 25ns 以上だとどのビーム が衝突したときにできた粒子なのかをタグすることが困難になる。テスト 検出器の読み出し ASIC のピーキングタイムは設計値が 20ns である。こ れは 1.25 ~ 10.0 fC の電荷信号のスレッシュホルド 1fC でのタイムウォー クを 16ns 以下にしタギングを可能にするという要請から来ている。図 20 を見ると、どのテスト検出器もピーキングタイムはだいたい 20ns くらい になっていることがわかり、設計値通りになっていることが確認できた。

# 3.6 モジュールの検出効率の評価

**3.6.1** 検出効率の決定方法

検出器を通過する荷電粒子の検出効率の決定方法を述べる[6]。モジュー ル上の粒子の通過位置はテレスコープにより決定されている。この通過 位置から前後5ストリップの領域を考え、其の中にクラスタ中心点があ れば、モジュールは粒子を検出したとする。実際にあるクラスタ中心点 の数を N<sub>Exp</sub>、上の条件を満たしたクラスタ中心点の数を N<sub>Real</sub> と置けば、 1イベントでの検出効率 *e* は次のようにあらわされる。

$$\epsilon = \frac{N_{\text{Real}}}{N_{\text{Exp}}}$$



図 17: 様々なスレッシュホルドにおけるトリガからの時間に対する検出 効率



図 18: 横軸は時間、縦軸はスレッシュホルド。図 17の様々なスレッシュ ホルドに対して 2 次元プロットを行った。



図 19: 40ns でのスレッシュホルドに対する検出効率



図 20: ASIC 内のパルスハイト

クラスタ中心点は1つしかないので、上記の式における $N_{\text{Real}}$ の取りうる値は1か0かである。イベント数iだけこれを繰り返し、次の式から検出効率( $\epsilon$ )を定めた。

$$\epsilon = \sum_{i=1}^{n} \frac{(N_{\text{Real}})_i}{(N_{\text{Exp}})_i}$$

誤差に関してであるが、N<sub>Real</sub>は先に述べた通り二項分布

$$P(r) =_{\mathrm{Exp}} C_{\mathrm{r}} \epsilon^{E_{\mathrm{Exp}}} (1-\epsilon)^{N_{\mathrm{Exp}}-r}$$

に従うので、その分散は  $N_{\mathrm{Exp}}\epsilon(1-\epsilon)$  となる。よって、検出効率の分散は

$$\sigma = \sqrt{Var(\frac{N_{\text{Real}}}{N_{\text{Exp}}})} = \sqrt{\frac{N_{\text{Exp}}\epsilon(1-\epsilon)}{N_{\text{Exp}}^2}} = \frac{\sqrt{N_{\text{Exp}}\epsilon(1-\epsilon)}}{N_{\text{Exp}}}$$

となる。

#### 3.6.2 スレッシュホルド 1fC での検出効率の電圧依存性

図21にスレッシュホルド1fCでの検出効率の電圧依存性を示している。 この図から放射線損傷を与えていないテスト検出器では電圧100V以上で 放射線損傷を与えたテスト検出器では電圧300V以上でそれぞれ検出効率 99

3.6.3 電圧一定での検出効率のスレッシュホルド依存性

実際の実験におけるデータ収集は、ある一点でのスレッシュホルドで固 定して行う予定であり、その値は1fC付近である。グラフを図22、図23、 図24、図25、図26、図27にしめした。1fcでの検出効率をみると放射 線損傷を与えていないモジュールでは70V以上、放射線損傷を与えたモ ジュールについては300V以上でいずれも99%以上の検出効率をしめして いることが分かる。実際のアトラス実験では放射線損傷を与えていないモ ジュールでは150Vで、放射線損傷を与えたモジュールでは300V~400V で稼働する予定であるのでよい結果といえる。



図 21: efficiencyの電圧依存性



図 22: 検出効率のスレッシュホルド依存性 (モジュール1)



図 23: 検出効率のスレッシュホルド依存性 (モジュール 2)



図 24: 検出効率のスレッシュホルド依存性 (モジュール3)



図 25: 検出効率のスレッシュホルド依存性 (モジュール 4)



図 26: 検出効率のスレッシュホルド依存性 (モジュール 5)



図 27: 検出効率のスレッシュホルド依存性 (モジュール 6)

3. 解析結果

#### 3.6.4 メディアンチャージのバイアス電圧依存性

あるスレッシュホルドにおける検出効率は、そのスレッシュホルド以 上の大きさをもつすべての信号の積分形であるので、検出効率が 50%で のスレッシュホルドの値が波高分布におけるメディアンチャージになる。

一般に、薄い物質中を通過する荷電粒子のエネルギー損失はランダウ 分布に従うので、得られたプロットをランダウ分布でフィットし、検出効 率 50%でのスレッシュホルドの値を出す。これらから、そのときにかけ ていたバイアス電圧依存性を知ることが可能になる。

検出効率のスレッシュホールド依存性をあらわす分布図 22~27 から、 各バイアス電圧ごとにメディアンチャージの値を出し、縦軸にメディア ンチャージの値を、横軸にバイアス電圧をとり、その依存性を評価した。 図 28 にこれを示す。高バイアスになるにしたがって、曲線の変化はだん だん緩やかになり、一定の値に近づく。検出器が全空乏層化電圧 70V に 達した後は、検出効率がそれほど変化しなくなることをあらわしている。 図をみると放射線損傷を与えていないモジュールでは 130V より高い電圧 では 3.7fC~4.0fC で一定の値に近づいて来ていることが分かる。放射線 損傷を与えたモジュールでは飽和には達していないが 3.7fC 程になってき ている。

#### 3.6.5 ノイズオキュパンシーの評価

LHC実験と同様、このビームテストでも40MHz ランダム・サンプリン グでおこなっている。つまり25ns毎にデータを検出器に読みにいってい る。これはLHC実験では25nsごとにビームが衝突するため、どのビーム のデータかをタグする必要が生じるからである。図29に概念図をしめし ている。タイミング1,2,3で読みにいっている。タイミング1の後の25ns はタイミング1にタグできる。しかし、今回ビームテストを行った高エ ネルギー加速器研究機構(KEK)の12GeVPSのπ<sup>-</sup>ビームラインは約2 秒周期でビームが衝突する。よって、ビームが来ていないときのテスト 検出器のヒット情報のデータをとることによってテスト検出器の電気的 ななノイズを評価できる。トリガーはテスト検出器群の上流と下流にお き、ビームとの同期を取った。

トリガーからタイミング2でビームが当ったことが言えれば、タイミ ング1はビームがあたる25ns前の情報である。このタイミング1の時間 を0nsとし15nsより前の時間ののデータを用いてノイズの評価を行った。



図 28: メディアンチャージのバイアス依存性

位置分解能のところでヒットがあったとする条件を決めるとき、テレスコープの通過位置より算出されたストリップから前後5ストリップ内にテスト検出器のヒットがあればそれをヒットとみなす、とした。ノイズの評価では、その2倍の前後10ストリップの外にヒットがあればそれをノイズのヒットとみなすとした。図30にノイズオキュパンシーのスレッシュホルド依存性を示した。スレッシュホルドの低いところでエレクトロニクスのノイズが見られる。テスト検出器に要請されるノイズオキュパンシーはバレルモジュールにおいてスレッシュホルド1fCで放射線損傷を与えていないものに関しては $1 \times 10^{-4}$ 、放射線損傷を与えたものにかんしては $1 \times 10^{-3}$ である。なぜ、この数値かという理由は以下の通りである。

まず、本物のトラックによるオキュパンシーがある。これがシミュレー ションによれば5×10<sup>-3</sup> 程度ある。したがってノイズによるオキュパン シーはこれ以下にする必要がある。テスト検出器によって取られたデー タは後処理の為に送信しなければならない。データ量が多すぎるとデッ トタイムが発生する。どれだけのデータ量をどれだけのスピードで送れ ばデットタイムがなくなるか。それが5×10<sup>-3</sup> 程度ならよい。そして放 射線損傷を受けるとノイズが増加する。よって値を一桁下げておく。図 30 をみるとその要請を満たしていることが分かる。

ノイズオキュパンシーとスレッシュホルドの関係は次の式で近似される。

$$occupancy(q) \propto exp rac{q^2}{2\sigma^2}$$

ここで $\sigma$ はアンプの Euivalent-Noise-Charge(ENC)、qはスレッシュホル ドである。これを図 30 にフィットした。

3.6.6 較正スケールに依存しない信号雑音比の電圧依存性の評価

チップの較正用のキャパシタンスの大きさには個体によって誤差、つ まり不確定性がある。それをキャンセルするためにメディアンチャージ をオキュパンシーで割った値、S/N ratio によってキャリブレーションス ケールに依存しない信号雑音比を評価する。その電圧依存性を示したも のが図 31 である。

放射線損傷を与えていないモジュールではS/N>14,放射線損傷を与え たモジュールではS/N>9(bias>350V)となっていることが分かる。ここ で実用に耐える経験値というものを我々は知っていてその値がだいたい



図 29: 40 MHz ランダムサンプリング



図 30: ノイズオキュパンシーのスレッシュホルド依存性

3. 解析結果

9 である。よって、アトラス 10 年分の照射量を与えた後でもこのテスト 検出器は十分動作することが分かる。



図 31: 較正スケールに依存しない信号雑音比の電圧依存性

#### 4. 結論

# 4 結論

2000 年 12 月高エネルギー加速器研究機構において、4GeV/cπ<sup>-</sup>ビーム を用いて行われたアトラス SCT モジュールのビームテストを行い、得ら れたデータを解析して、検出器の性能を評価した。今回のビームテスト は、量産及び量産直前のパーツを用いて行った最初の実験である。

位置分解の評価を行った。放射線損傷を与えていないモジュールは80µm ピッチの一様分布から期待される位置分解能23µm を与えた。

読み出し ASIC 内の信号波解析を行った。ピーキングタイムは約 20ns であり、設計値とほぼ同じ値であることを確認した。

検出効率について評価した。検出効率のスレッシュホルド依存性はアト ラス実験で使用される1fCのスレッシュホルドにおいて検出効率が99%以 上であった。また、電圧依存性は放射線損傷を与えていないモジュールに ついては150V、放射線損傷を与えたモジュールについては350V~400V で検出効率が99%であることが分かった。どちらも大変良好であるとい える。

モジュールに LHC 実験 10 年間で受ける放射線量  $3 \times 10^{14}$  protons/ $cm^2$  を当てた後でも、S/N はバイアス電圧 350V で 10 より大きく、実用に耐 える 9 を満足していることがわかった。

#### 5. 謝辞

# 5 謝辞

指導教官である岡山大学・中野逸夫教授にはアトラスのビームテスト への参加、そしてデータ解析の機会を与えて下さいました。高い水準の 場で研究がしたいという私のわがままを聞き、その機会をつくって頂く ために大変な尽力をつくして頂きました。

岡山大学・田中礼三郎助教授にはビームテストにおいて実験の方法、考 え方など教えて頂きました。また、それを自ら実践されているのをみて 多くの影響を受けました。

高エネルギー加速器研究機構(KEK)・海野義信助教授には、私がKEK で研究している間、解析の手法、データから物理現象を想像するかといっ た極めて実践的な指導を賜りました。

以前のビームテストの解析をされた橋崎徹先輩には、この解析を始め るに当って知っておかなければならないことを、本人の経験から語って くださったので大変参考になりました。

また、解析結果を見て、鋭い指摘、アドバイスをくれた博士前期課程 2年越野俊充君、乗松健治君には大変感謝しています。

我々の実験は多くの人々の協力が無ければ遂行できません。この実験 を共に行った各大学、研究機関の方々に感謝いたします。

# 参考文献

- [1] William R.Leo," Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments", Springer-Verlag, 1994
- [2] G.F.Knoll,"Radiation Detection and Mesurement Third Edition", John Wiley & Suns, Inc., 2000
- [3] P.R.Bevington,"Data reduction and error analysis for the physical sciences", New York,McGraw-Hill,1992
- [4] S.M.Sze,"Physsics of Semiconductor Devices", John Wiley & Suns. Inc., 1981
- [5] CERN Program Library PAW Reference
- [6] 橋崎徹,"ATLAS SCT モジュールの性能評価",岡山大学修士論文,2001
- [7] B.W.Kernighan, D.M.Ritchie, "The C Programming Language", Prentice Hall, 1988

# 口頭発表

松尾武,海野義信,中野逸夫,田中礼三郎,高力孝近藤敬比古,寺田進,池上 陽一,氏家宣彦高島隆一,原和彦,岩田洋世,大杉節

"KEK 12GeV PSでのビームテストによる ATLAS SCT モジュールの性 能評価"

日本物理学会秋期大会,2001年9月22日~25日,沖縄国際大学

# 論文発表

Y.Unno,T.Matuo,T.Hashizaki,T.Akimoto,J.Bernabeu,Z.Dolezal,L.Eklund, K.Hara,Y.Ikegami,Y.Iwata,Y.Kato,C.Ketterer,H.Kobayashi,T.Kohriki, T.Kondo,T.Koshino,J.Ludwig,T.Masuda,G.Moorhead,I.Nakano,K.Norimatsu, T.Ohsugi,K.Runge,S.Shinma,R.Takashima,R.Tanaka,N.Tanimoto,S.Terada, N.Ujiie,M.Vos,K.Yamanaka,and T.Yamashita "Beamtest of Non-irradiated and Irradiated ATLAS SCT Microstrip Modules at KEK"; IEEE trans.Nucl.Scie